課題番号 :F-18-KT-0160

利用形態:機器利用

利用課題名(日本語) :レーザー実験用擾乱ターゲットの製作

Program Title(English) : Production of corrugated target for laser experiment

利用者名(日本語) :松尾一輝,石榑一貴

Username(English) : <u>K. Matsuo</u>, K. Ishigure

所属名(日本語) : 大阪大学レーザー科学研究所

Affiliation(English) : Institute of Laser Engineering, Osaka University

キーワード/Keyword :リソグラフィ・露光・描画装置、高速マスクレス露光, エッチング

## 1. 概要(Summary)

京都大学ナノテクノロジーハブ拠点の装置、技術を 利用して微細な擾乱のついたフォイルを高精度かつ 大量に製作することを目的とする. 擾乱のついたフォ イルは, 主に流体不安定性解明のための基礎実験に使 用する. 流体不安定性の研究は、超新星爆発に伴う衝 撃波と非一様密度の星間磁化プラズマとの相互作用の理 解といった天文, 宇宙物理分野や慣性核融合実現のため のターゲットデザインの最適化といった核融合分野など 様々な研究分野で重要な課題として認知されている.流 体不安定性の研究に広く使われる擾乱のついたフォイル をなるべく精密に作ることは、実験精度、誤差に直接影 響するため、高精度かつ個体差の少ないターゲットをな るべく多く作ることが求められる. 利用者等は製作した 高精度かつ個体差の少ない擾乱のついたフォイルを利 用して,精密な実験を行うことで,天文,宇宙,核融 合等の分野に広く資する学術的成果を期待している.

## 2. 実験(Experimental)

## 【利用した主な装置】

高速マスクレス露光装置,磁気中性線放電ドライエッチング装置、

#### 【実験方法】

高速マスクレス露光装置を用いてサイン波形状のパターンを描画し、磁気中性線放電ドライエッチング装置でシリコン基盤をエッチングした. サイン波形状のパターンが印可されたシリコンの基盤を、大阪大学レーザー科学研究所に持ち帰り、基盤上でプラスチックを成膜することで、プラスチックにサイン波形状のパターンを転写した.

## 3. 結果と考察 (Results and Discussion)

作製した基盤を評価するために、SEM による断面計測を行った. 作成された基盤には、綺麗なサイン波形状のパターンが印可されていた. (Fig.1)作成した基盤上

で成膜を行うことにより、プラスチックの平板にパターンを 転写した. プラスチックの平板には基盤と同じパターンが 転写されていることが確認できた. (Fig.2) 基盤は何度 でも使用可能である. 京大ナノハブにて作製した基盤と 阪大レーザー研の成膜技術を組み合わせることで、高精 度かつ個体差の少ないターゲットを大量に製作する方 法を確立することができた.

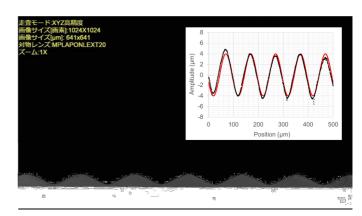


Fig.1: Measurement was carried out by SEM. The frame has sinusoidal wave pattern.

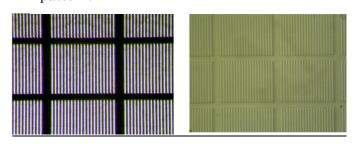


Fig.2: Photo of the frame (left) and transferred plastic foil (right).

# 4. その他・特記事項(Others)

- ・共同研究者: 佐野孝好(大阪大学レーザー科学研究所)
- 5. 論文·学会発表 (Publication/Presentation)

なし。

## 6. 関連特許(Patent)

なし。